

## 最近公開された出願特許

2007年10月1日～2008年9月30日

- 特開 2008-223093 成膜装置のクリーニング方法  
 特開 2008-218861 FRP 製クライオスタットの製造方法  
 特開 2008-216156 管継手の締め付け角度判定方法及び管継手の締め付け角度判定治具  
 特開 2008-215863 安定同位体濃度の分析方法  
 特開 2008-215804 液体窒素の冷却方法  
 特開 2008-215640 超電導コイルの冷却装置およびこれに用いる通気板  
 特開 2008-212845 一酸化炭素吸着剤、ガス精製方法及びガス精製装置  
 特開 2008-205090 気相成長装置  
 特開 2008-196882 ガス分析装置  
 特開 2008-196687 低温液化ガス供給方法及び装置  
 特開 2008-196031 気相成長装置  
 特開 2008-192865 気相成長装置  
 特開 2008-190715 低温液化ガス供給装置及び方法  
 特開 2008-177380 気相成長装置  
 特開 2008-177209 プラズマエッチング方法  
 特開 2008-177187 気相成長装置及び気相成長方法  
 特開 2008-175518 熱交換器  
 特開 2008-164236 窒素製造方法及び装置  
 特開 2008-164177 熱交換器  
 特開 2008-164115 配管加熱用のヒータ装置  
 特開 2008-153409 希釈冷凍機  
 特開 2008-152379 配管作図装置、配管作図方法、コンピュータプログラム及び記録媒体  
 特開 2008-139242 半導体製造装置からの排ガスの分析方法  
 特開 2008-138910 ヘリウム液化機  
 特開 2008-132418 蒸留装置  
 特開 2008-130971 高抵抗 GaN 薄膜及びその気相成長方法  
 特開 2008-128923 FABMS 測定の前処理方法  
 特開 2008-128922 安定同位体濃度の分析方法  
 特開 2008-128613 希釈冷凍機  
 特開 2008-128566 金属溶湯の燃焼抑制用ガス供給装置、及び、金属溶湯の燃焼抑制用ガス供給方法  
 特開 2008-116108 カバーガスの供給方法  
 特開 2008-096055 ヘリウム精製装置の運転方法  
 特開 2008-095820 逆止弁及び低温流体用ポンプ  
 特開 2008-091394 電界効果トランジスタ及びその製造方法  
 特開 2008-080311 ガス分離装置における制御方法、制御装置、プログラム、及び、記録媒体  
 特開 2008-080260 圧力変動吸着式ガス分離方法および分離装置  
 特開 2008-080200 酸素同位体重量成分の濃縮方法および濃縮装置  
 特開 2008-076357 ガスサンプリング装置およびガスサンプリング方法  
 特開 2008-075705 低温液化ガスポンプの起動方法  
 特開 2008-075170 アルミニウム溶湯処理剤および処理方法  
 特開 2008-073656 レーザ光化学反応における送ガス方法  
 特開 2008-073655 光化学反応を安全に進行させる方法  
 特開 2008-064593 車両の積載重量算出システムにおける荷重センサ出力補正量決定用データ収集装置  
 特開 2008-061522 嫌気性超好熱菌用ろ過培養装置及び水素の製造方法  
 特開 2008-061521 水素の製造方法及び水素製造装置  
 特開 2008-060171 半導体処理装置のクリーニング方法  
 特開 2008-053360 気相成長装置  
 特開 2008-053359 気相成長装置  
 特開 2008-053279 気相成長装置  
 特開 2008-049349 ガス切断方法  
 特開 2008-045193 浸炭用雰囲気ガス発生装置及び発生方法  
 特開 2008-039440 安全弁装置及びガスサンプリング容器  
 特開 2008-039362 パーナ及び粉体可燃物の燃焼方法並びに冷鉄源の溶解・精錬方法  
 特開 2008-039025 ガス昇温抑制方法及び装置  
 特開 2008-037712 ホウ素系ガス中の金属不純物の除去方法  
 特開 2008-037706 合成ガス製造用燃焼装置及び合成ガス製造方法  
 特開 2008-021708 気相成長装置  
 特開 2008-018307 制御装置、及び異常検出方法  
 特開 2008-014813 真空度測定装置、気相成長装置および真空度測定方法  
 特開 2008-008388 高圧ガス供給方法  
 特開 2008-001735 シール材  
 特開 2008-000662 吸着筒  
 特開 2007-333273 希釈冷凍機  
 特開 2007-326155 ショット材ブラスト装置  
 特開 2007-321867 フレキシブルチューブ  
 特開 2007-321775 ガス容器の載置台  
 特開 2007-318070 絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜  
 特開 2007-318067 絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜  
 特開 2007-302435 ドライアイスのガス搬送機構およびドライアイス噴射装置  
 特開 2007-298485 車両の積載重量算出方法及びその装置  
 特開 2007-297605 メタン分離方法、メタン分離装置及びメタン利用システム  
 特開 2007-297249 ガラスフリット  
 特開 2007-292705 車両の積載重量算出方法及びその装置  
 特開 2007-291515 微粒子、その製造方法及び製造装置  
 特開 2007-289854 酸素同位体の濃縮方法および濃縮装置  
 特開 2007-283253 充填剤充填装置  
 特開 2007-283252 充填筒及び充填剤排出装置  
 特開 2007-283251 充填筒装置  
 特開 2007-278581 パーナ又はランスの冷却構造  
 特開 2007-273660 気相成長装置  
 特開 2007-271279 凍結保存器  
 特開 2007-263905 液化ガスの濃縮分析装置  
 特開 2007-263678 水素化合物ガス中の微量不純物分析方法及び装置  
 特開 2007-258633 気相成長装置  
 特開 2007-258516 気相成長装置  
 特開 2007-255666 ガス供給装置およびガス供給方法  
 特開 2007-254168 過酸化水素水の精製方法  
 特開 2007-253098 有害ガスの除害方法および除害装置  
 特開 2007-253082 有害ガスの除害装置  
 再表 2006/106878 カルシウム及び／又はマグネシウムを含む多孔質粒子からなる粒状物  
 再表 2006/104039 ガス処理装置  
 再表 2006/068231 金属超微粉の製造方法  
 再表 2006/033367 カーボンナノ構造物の製造方法及び製造装置  
 再表 2006/013706 触媒粒径制御式カーボンナノ構造物の製造方法、製造装置及びカーボンナノ構造物  
 再表 2005/118473 原料吹き付け式高効率カーボンナノ構造物製造方法及び装置  
 再表 2005/094986 空気液化分離装置の前処理精製装置、炭化水素吸着剤、及び原料空気の前処理方法

以上 96 件